МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___" _____ 2024 р.

Спеціальність	132 Матеріалознавство	Факультет/ННІ	Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Освітня програма	Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	Форма здобуття вищої освіти	*Очна (денна)*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії*	Кваліфікація	Магістр з матеріалознавства

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години									СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор													1 курс							
																									НН-41мп (Б: 15, К: 0);							
																									1 семестр				2 семестр			
																									18 тижнів				18 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																																
Цикл загальної підготовки																																
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Право інтелектуальної власності)*	КМ	15	0	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12									1	0.67	0.33					
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Патентознавство та набуття прав)*	КІВПП	15	0	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24		1	1						2	1.33	0.67					
3	*Основи інженерії та технології сталого розвитку*	ШІ	15	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		1	1						2	1	1					
4	*Педагогіка вищої школи*	ПП	15	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		1	1						2	1	1					
5	*Менеджмент стартап-проєктів*	МП	15	0	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		2	2										3	1	2	
6	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації*	АМТС2	15	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18		2	1					1	2		2		2		2	
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					13	390	252	90	0	162	0	0	0	0	138	0	5	5	0	0	0	0	1	9	4	5	0	5	1	4	0
Цикл професійної підготовки																																
7	*Інженерне матеріалознавство. Частина 1*	ВМПМ	15	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	1		1					1	3	2	1					
8	*Інженерне матеріалознавство. Частина 2*	ВМПМ	15	0	3.0	90	54	-	-	-	-	54	-	0	36		2											3			3
9	*Інженерне матеріалознавство. Курсова робота*	ВМПМ	15	0	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30		2		2												
10	*Фізика міцності і руйнування*	ВМПМ	15	0	4.0	120	36	18	-	-	-	18	-	0	84		1	1						2	1		1				
11	*Вибір і комп'ютерний дизайн матеріалів*	ВМПМ	15	0	4.0	120	54	27	-	-	-	27	-	0	66		1	1						3	1.5		1.5				
12	*Фундаментальні засади теорії та технології порошкових і композиційних матеріалів*	ВМПМ	15	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	1		1						3	2		1				
13	*Наукові основи створення наноматеріалів*	ВМПМ	15	0	4.0	120	36	27	-	-	-	9	-	0	84		1	1						2	1.5		0.5				
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					26	780	288	144	0	18	0	126	0	0	492	2	5	5	1	0	0	0	1	13	8	1	4	3	0	0	3
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					39	1170	540	234	0	180	0	126	0	0	630	2	10	10	1	0	0	0	2	22	12	6	4	8	1	4	3
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																																
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																																
14	*Електронно-зондові методи аналізу речовин та матеріалів*	ВМПМ	15	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
15	*Мікроскопія і адсорбційний аналіз наносистем*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
16	*Магнітні та електротехнічні порошкові матеріали*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
17	*Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів*	ВМПМ	15	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
18	*Дифракційні методи дослідження наноматеріалів*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
19	*Матеріали паливних комірок*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	-	-	18	-	0	96	2		2										3	2		1
20	*Надтверді матеріали та тверді сплави*	ВМПМ	15	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
21	*Порошкові та композиційні матеріали для медицини*	ВМПМ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
22	*Сучасні технології 3D друку*	ВМПМ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
23	*Фізика і хімія наносистем*	ВМПМ	15	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2										3	2	1	
24	*Дисперсні системи та поверхневі явища*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2										3	2	1	
25	*Атомістична інформатика матеріалів*	ВМПМ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2		2										3	2	1	
26	*Теорія і технологія нанопокриттів*	ВМПМ	15	0	4.0	120	36	18	-	-	-	18	-	0	84		2	2										2	1		1
27	*Фрактодіагностика руйнування матеріалів*	ВМПМ	0	0	4.0	120	36	18	-	-	-	18	-	0	84		2	2										2	1		1
28	*Основи планування багатофакторного експеримента*	ВМПМ	0	0	4.0	120	36	18	-	-	-	18	-	0	84		2	2										2	1		1
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	252	162	0	36	0	54	0	0	438	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	2	3
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	252	162	0	36	0	54	0	0	438	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	2	3
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					62	1860	792	396	0	216	0	180	0	0	1068	5	12	15	1	0	0	0	2	22	12	6	4	22	10	6	6

Кількість															
	Кількість екзаменів	5	2				3								
	Кількість заліків	12		6				6							
	МКР	15			9				6						
	Курсових робіт	1								1					
	Курсових проєктів	0													
	РГР, РР, ГР	0													
	ДКР	0													
	Рефератів	2				2									

Ухвалено на засіданні Вченої ради ННІМЗ ПРОТОКОЛ № 5/24 від 2024-05-16

Завідувач кафедри ВМПМ _____ Юрій БОГОМОЛ
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;